

令和3年12月吉日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第145委員会
委員長 柿本 浩一

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
第175回研究会開催通知

日時： 2022年3月3日(木) 13:00~17:20

テーマ： 「Si系先端デバイスを支える加工・評価技術」

世話人： 泉妻宏治(グローバルウエーハズ・ジャパン)、佐俣秀一(SUMCO)、
小椋厚志(明治大学)

プログラム：

- 13:00~13:25 委員総会、
開会の挨拶 柿本 浩一(九州大学)
- 13:25~13:30 はじめに 泉妻宏治(グローバルウエーハズ・ジャパン)
- 13:30~14:10 半導体シリコンウエーハ固定砥粒切断の現状と将来性
河津 知之(コマツ NTC)
- 14:10~14:50 枚葉式シリコンウエーハ洗浄装置とその最新動向
今岡 裕一(芝浦メカトロニクス)
- 14:50~15:00 総合討論(加工) 泉妻宏治(グローバルウエーハズ・ジャパン)
- 15:00~15:10 休憩
- 15:10~15:50 カソードルミネッセンス(CL)法によるSiプロセス最適化
杉江 隆一(東レリサーチセンター)
- 15:50~16:30 実験室系硬X線光電子分光の現状と展望
町田 雅武(シエンタオミクロン)
- 16:30~17:10 IV族半導体のフォノン物性評価 —LSI および熱電素子応用を目指して
横川 凌(明治大学)
- 17:10~17:20 総合討論(評価) & おわりに 佐俣秀一(SUMCO)